

ヘラ型アタッチメント Spatula-type attachments

ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。

Spatula-type attachments have been designed for suction, and carrying large dimension circular or square plates. Both stainless steel spatulas and Teflon coated spatulas are provided.

The spatula-type attachments are appropriate for the handling of silicon wafers, CDs and glass plates.

C1-T, C1-M
15gまで
to 15g



C3-T, C3-M
20gまで
to 20g



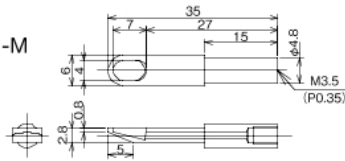
C5-T
60gまで
to 60g



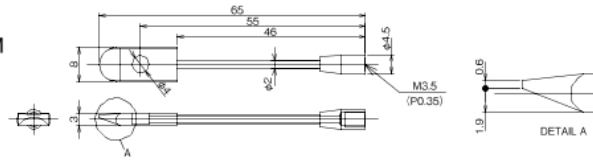
C8-T
70gまで
to 70g



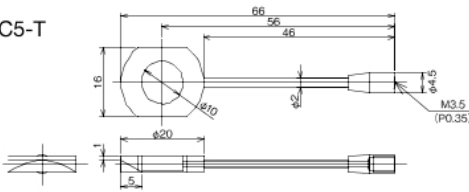
C1-T, C1-M



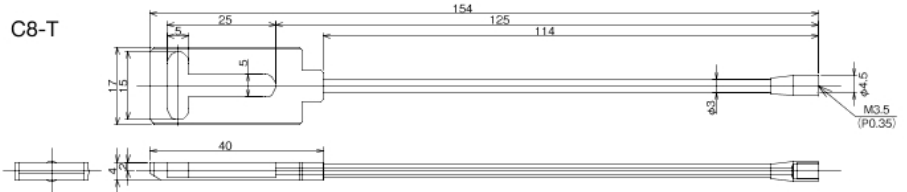
C3-T, C3-M



C5-T



C8-T



真空ポンプ DAP-12S セット DAP -12S Vacuum pump set



弊社特選DAP-12Sは、ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。

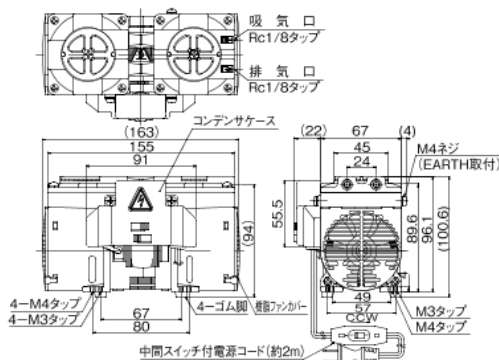
油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。

ビニールホース1.5m (φ8×φ11) と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1個が付属されています。

DAP-12S is a diaphragm type vacuum pump that uses the reciprocating motion of a rubber film.

No oil is used, so the exhaust from the unit keeps the environment clean and maintenance is easy.

The unit comes with an accessory 1.5m vinyl hose (φ8×φ11), coupling joint JT-1, and a special nipple.



実効排気速度 Effective exhaust velocity	L/min.	12	14
到達圧力 Ultimate pressure	Torr(Pa)	24.0 × 10 ³ (-77.3kPa)	
使用電動機 Motor used	—	単相、100V.10W. 4p コンデンサ運転 Single phase. 100V.10W. 4poles.capacitor run	
全負荷電流 Full-load current	A	0.5	
質量 Mass	kg	1.9	
吸気管径 Suction hose diameter	mm	(Rc 1/8)	
使用雰囲気温度範囲 Atmospheric temperature range	℃	0 ~ 40	
最大寸法 Maximum dimensions	mm	93(W) × 163(L) × 100.6(H)	
RoHS 対応 RoHS Compliant	—	対応しています Compliant	

到達圧力の () 内はゲージ圧表示です。

The ultimate pressure figure in parentheses () is the gauge pressure display.

